書類番号 : 創研-DB10-171 NC

作 成 日 : 平成22年5月10日

住友精密工業株式会社

□出張報告書■会議議事録

件名

11月度創研部内会議(社外秘)

部課名	認可	審査	作成
創事業研究部	高橋		高 橋

日	時	H22.11.05(月) 15:00~16:30	場	所	創事業研究部会議室
出席:	者	八木取締役、川上技師長、高橋支配 内田G長、越智M、久野M、高橋(記		上森	次長、庄谷技術主幹、佐藤M、折島M、
関連資料		部内会議101105.doc			
配布:	出席者 x 1、高祖ラボ長				

1. 共通事項

- (1) 八木取締役より社内での事故(クレーンがぶつかる)、ケガ(クーリングタワーの修理中)等多発しており、 各部員に安全に対して今一度注意喚起を徹底するよう指示を受けた。
- (2) SOFC 派遣中島さんの PC のデータ吸い上げと情報システムへの返却処置促進のこと。
- (3) EX-IC カード利用について下記注意が必要
 - a. 新大阪~東京間のみのチケットで、それ以降の乗り継ぎができない。
 - b. 乗り継ぎが必要な場合には、ICOCA ないし SUICA カードによるプリチャージが必要。ないしは、一旦駅から出てチケットを自動販売機で購入する必要あり。従来どおりの発券方式も可能とのことだが。
 - c. Mobile SUICA も使用できない。(法人カードの為)
 - d. 改札でタッチした際に出てくるプリンタ用紙が検札時の証明になるので持参すること。
- (4) 知財副担当は山口 M の転籍に伴い、平川 AM に。(職制表で明示済み)

2. 産業機器チーム:

- 2.1. マルチプローブ
- (1) マルチプローブ描画装置は 12/6 出荷予定(販売額 3 千万円) これとは別に Tool 用基板 10set 分を 4500 千円で販売済み。
- 2.2. 大気圧プラズマシリコン結晶化装置
- (1) JST からの指示を受けながら Closure の処置すすめている。
- 2.3. TSV埋込装置開発
- (1) TSV 関係は今井 M、山口 M の転籍に伴い、MT に移管。
- 3. SOFC
- (1) 旋回火炎バーナーの技術について
 - a. 小金井テックスの技術評価は高い。(MHI 等のガスタービン用燃焼器等の開発試作を請負っている。)
 - b. 東京ガスのサブマージド技術におけるバーナー技術も参考になるはず。熱エネルギー技術部にコンタ クトすると有効。
- (2) 灯油機の新品スタックによる評価時間は可能な限り短くし、JX 現地での運転に備えること。
- 4. 一次伝面型熱交換器
- (1) 今後の対ヤンマー向けのアクションを明確にすること。
- 5. 複合材料実用化チーム
- 5.1. HTCC
- (1) アドバンテスト向けの受注活動について下記アクションをとること。

- a. SPP で実施している不具合対策処置の対客先処置(11 月末目標)
- b. 客先評価が 11 月末までに終了するとのこと。その結果の入手フォロー。併せて、客先での量産化の動き。
- (2) 溶接試験片を見たところ大変綺麗な溶接を行っているが? =>ベテランの溶接者に溶接をしていただいた。炭素繊維まで溶け込まない程度に溶接をおこなってもらった。

5.2. 潜水艦複合材プロペラ

- (1) 防衛省の意向も踏まえ MHI が SPP にプロペラ製造を依頼する検討をおこなっている。11/12 ないし 16 に 神戸造船所の設計課長が来社し協議予定。
- (2) この場合、GH クラフトのノウハウが SPP に万一提示されても SPP で対応できない可能性が高いので、 技術情報の移転については契約段階で十分に吟味すること。

5.3. 脚材料関連

(1) 特になし。

5.4. 経産省プロジェクト(TASC)

- (1) 11/8 の理事会と 11/22 の臨時総会で理事が現前野顧問から八木取締役に変更・選出される予定。
- (2) 来年度予算ならびに本年度補正予算で SPP の応用研究に絡んで 11/10 八木取締役と上森次長が SPP 東京本社で TASC 専務理事と事前の面談を行う。11/12 に SPP に来社予定。
- (3) 研究成果は適宜片桐 M から上森次長に上がってきており、少しづつ成果がでている。

6. 材ラボ

- (1) 液相析出法にて皮膜した SOFC 向けセルの調査は材料リサーチラボで実施中。
- (2) 次回より(4) 航機部門コア技術強化コラボレーション活動:メッキ WG 活動についても追記すること。

7. 知財・技術管理

- (1) 2010 年度創事業研究部の新規出願状況(下期は基本的に凍結)について紹介があった。
- (2) 2011 年度より図書購入費用及び特許出願・維持費用の負担を全社共通から部門負担に変更する予定。 =>部門負担になったとたんに図書の重複購入(無駄)、あるいは、研究開発費での購入(倫理的側面)など がないよう注意を喚起する必要がある。
- (3) 11/24 特許庁の方が航機降着装置製造工場を見学予定。これらは特許審査に関連して向学のために実施されるもの。

8. その他

(1) 参加登録費用および出張旅費抑制の観点からはセミナー参加は今後停止すること。

次回 12 月度の部内会議担当は上森次長にお願いします。ファイル名は"部内会議 2010.12.06.doc"です。

以上.